

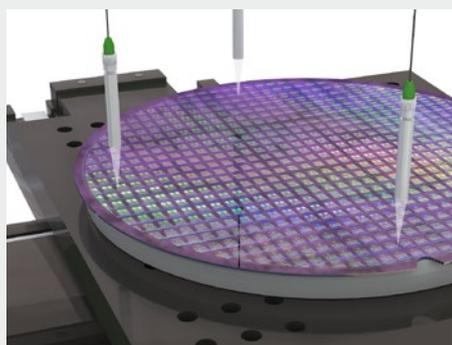
# 白色光干渉計

## interferoMETER

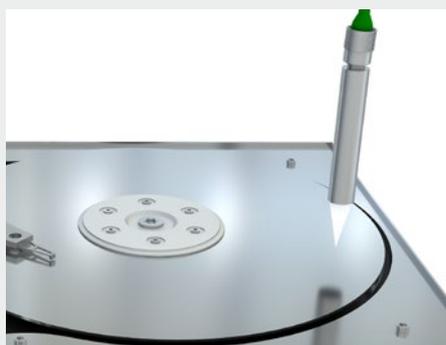
- 絶対の距離とマルチピーク距離測定
- 距離に依存しない厚みと重層厚み測定
- クラス最高の<30ピコメートルの分解能と卓越した直線性
- 新しい評価アルゴリズムと能動温度補正による高い信号安定性
- Webインターフェースを介した容易なパラメータ化
- バス接続も可能な多数のインターフェース



マイクロエプシロン社の革新的な白色光干渉計は、高精度な距離・厚み測定におけるベンチマークを打ち立てています。このセンサはサブナノメートルの分解能で安定した測定結果をもたらし、比較的広い測定範囲と長いオフセット距離を提供しています。当社では三機種の干渉計をご用意しています：高精度な工業用距離測定のためのIMS5400-DS、正確な厚み測定のためのIMS5400-TH、そしてピコメートル分解能の距離測定に対応した真空環境に適したIMS5600-DSです。



ウェハの傾斜試験



ハードディスクの軸振れ試験



板ガラスの厚さ測定



### interferoMETER 5400-DS

ナノメートル精度の絶対距離測定のための白色光干渉計

測定範囲	2.1 mm
直線性	< ±50 nm
分解能	< 1 nm
測定レート	最大6 kHz
マルチピーク距離測定 (厚み計算)	



### interferoMETER 5400-TH

サブマイクロメートル精度で安定した厚み測定を行うための白色光干渉計

作動距離	45 mm ±3.5 mm 70 mm ±2.1 mm
直線性	< ±100 nm
分解能	< 1 nm
測定レート	最大6 kHz
マルチピーク厚み測定	



### interferoMETER 5600-DS

サブナノメートル精度の絶対距離測定のための白色光干渉計

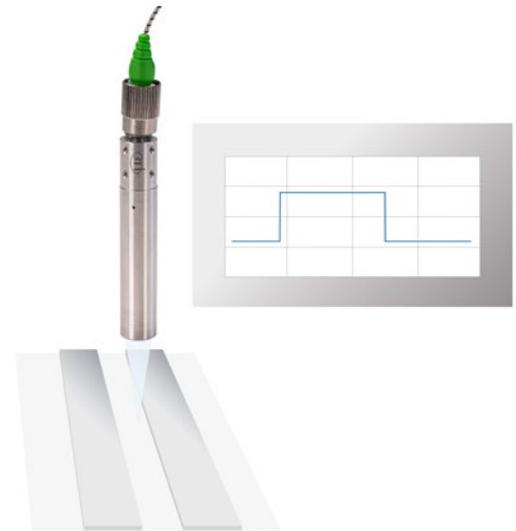
測定範囲	2.1 mm
直線性	< ±10 nm
分解能	< 30 pm
測定レート	最大6 kHz
マルチピーク距離測定 (厚み計算)	



### interferoMETER 5420

ウェハーの高精度厚み測定に対応した白色光干渉計

- 1 nmまでの分解能
- わずか20 μmのライトスポット直径
- ドープしていないウェーハとドープしたウェーハの測定 (p+/p++、5 Ω:cm)
- ウェブインターフェースでの容易な操作
- 一層および多層厚み測定可能



### 段付きプロファイルの絶対測定

従来の相対式測定を行う干渉計とは異なり、IMS-DSは段付きプロファイルの測定にも対応しています。絶対測定により、高い信号安定性と精度でスキャンが行われます。そのため、移動する測定対象物を測定する際にヒール、段差、くぼみの高低差を確実に検知することができます。

アナログ  
RS422

イーサネット



プラスチックフィルムの厚さ測定

### 工業環境への組み込み

堅牢なセンサおよび金属ハウジング内のコントローラは、自動製造システムや機械への干渉計の組み込み用に最適です。コンパクトなセンサは設置スペースを大幅に節減し、狭いスペースでも組み込むことができます。コントローラはDINレールを介して制御盤に設置することができ、能動温度補正機能および受動冷却機能により極めて安定した測定結果をもたらします。